

日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第145委員会
第110回委員総会議事次第

日時 2019年1月31日（木） 17:10～17:30
場所 明治大学駿河台キャンパス 大学会館第一、第二会議室

議題 1. 委員動静・幹事構成について
2. 2018年度の決算案と2019年度の予算案について
3. 2019年度の研究会企画について
4. 2020年ハワイシンポジウムについて
5. その他

配付資料 1. 第9期委員名簿
2. 2018年度決算案と2019年度予算案

【今年度定例研究会予定】

(1) 第162回研究会「半導体の微量・微小分析」
期日，場所：2019.1月31日
明治大学駿河台キャンパス 大学会館第一、第二会議室
世話人：佐俣、深田、上殿、関口

【来年度定例研究会予定】

- (1) 第163回研究会「窒化物半導体中の欠陥評価の最近の進展（161と合同）」
期日，場所：2019.5月8日
明治大学(予定)
世話人：酒井、三宅、上田
- (2) 第164回研究会「X線等を用いた評価関連」(委員総会開催)
期日，場所：第一候補2019年8月30日、第二候補2019年8月28、29日
明治大学駿河台キャンパス
世話人：志村、表、廣沢
- (3) 第165回研究会「SiCの現状と問題点そして将来の展開等」
期日，場所：2019.10月23日または11月13日
関西学院大学上ヶ原キャンパス関西学院会館
世話人：大谷、西澤
- (4) 第166回研究会「結晶薄化技術（仮題）」
期日，場所：2019年12月～2020年1月頃の開催を念頭に、未定
世話人：佐野、閻
- (5) 第167回研究会「シリコンフォトニクス関連（仮題）」
期日，場所：2020年1～2月開催を念頭に、未定
世話人：志村

【来年度主催国際会議予定】

(1) 会議名：2020年度ハワイシンポジウム
第8回 International Symposium on Advanced Science and Technology of Silicon Materials
期日，場所：2020年11月19日-21日

実行委員会委員長：末岡、プログラム委員長、西澤
Kona, Sheraton Hotel, Hawaii

第 145 委員会の HP <http://www.riam.kyushu-u.ac.jp/nano/gakushin145/>